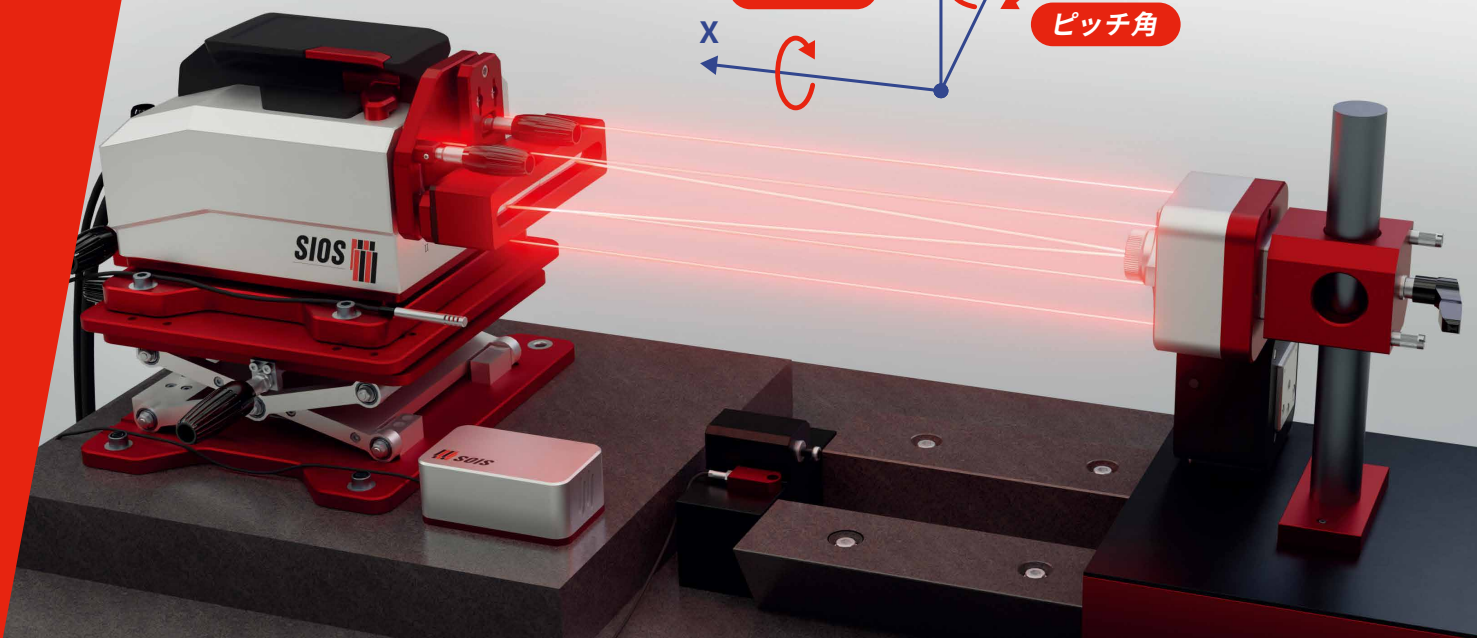
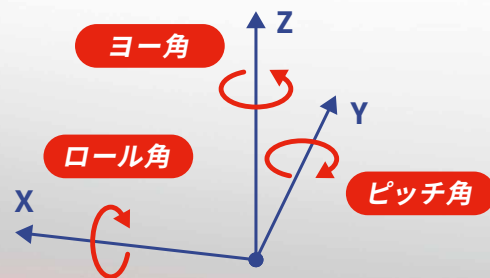


半導体検査機器・精密加工機器、
超高精度3次元計測器などに!!

超高精度位置決め モニタリングシステム

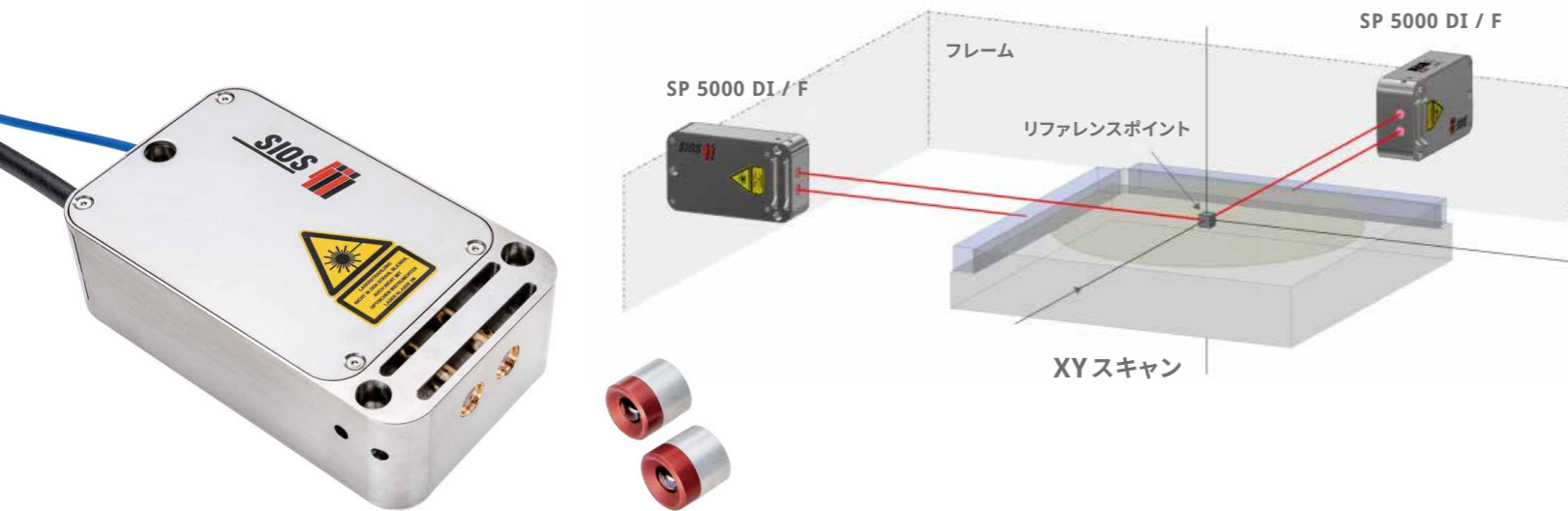
超高精度レーザー干渉測長計



次世代半導体検査設備、高精度の3次元計測機器など、
高い安定性を長時間求められる位置決め、
モーションコントロールにご使用になれます。

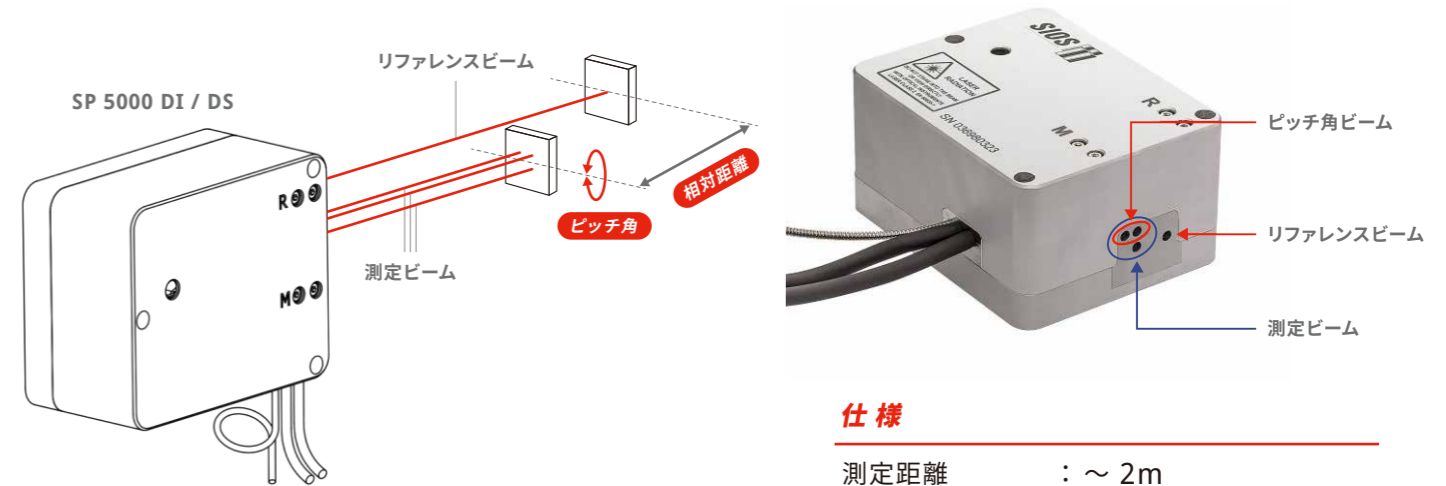
ディファレンシャル干渉計 SP-DI/F

基準点と対象物までの **相対距離** を精密測定します。



マルチビーム ディファレンシャル干渉計 SP-DS/DI

基準点と対象物までの **相対距離** と **ピッチ角** を精密測定します。



仕様

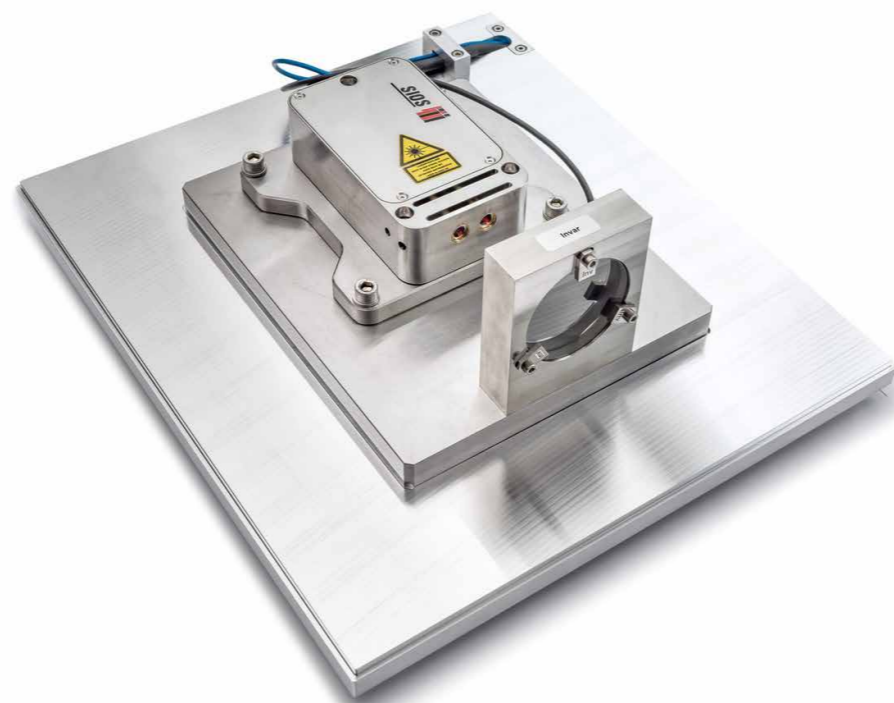
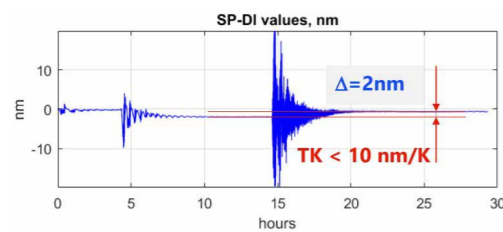
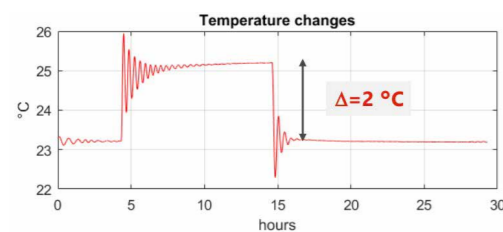
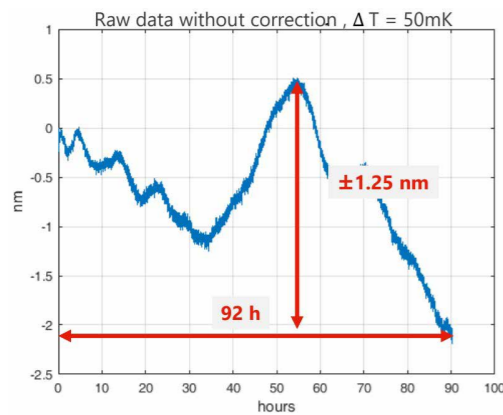
測定距離	: ~ 2m
長さ分解能	: 5µm
長さ不確かさ	: 0.15µm/m
ピッチ角測定範囲	: ±430µrad
角度分解能	: 0.0035arcrad
角度不確かさ	: ±0.04% ±0.04µrad

特長

- ✓ 超高安定性の長さ / ピッチ角測定
- ✓ XYステージの精密位置合わせ
- ✓ < 20nm/K: 温度変化による感度

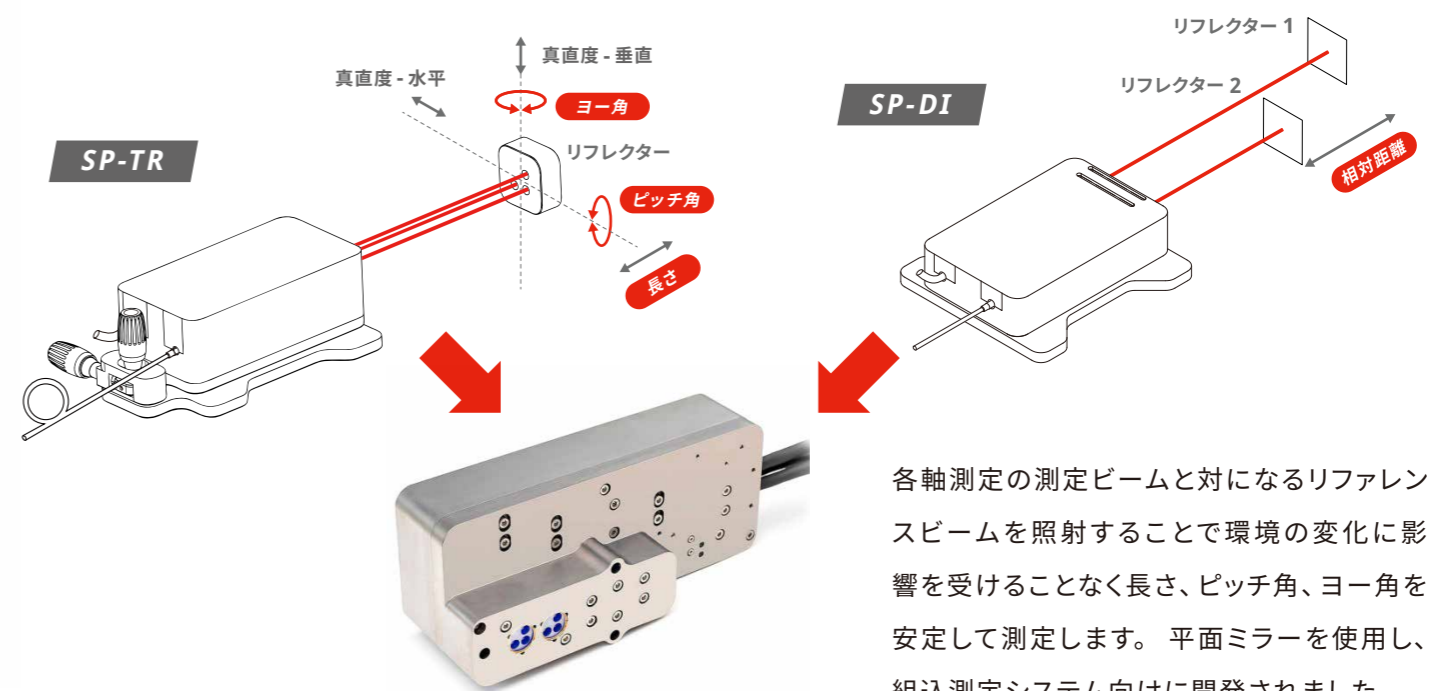
シリーズ史上、最高性能モデル

測定中の温度変化などによる外乱からの影響をキャンセルできる構造となっており、長時間測定でも非常に安定した測定が可能なモデルです。



トリプルビーム ディファレンシャル干渉計

基準点と対象物までの **相対距離** と **ピッチ角**、**ヨー角** を精密測定します。



各軸測定の測定ビームと対になるリファレンスビームを照射することで環境の変化に影響を受けることなく長さ、ピッチ角、ヨー角を安定して測定します。平面ミラーを使用し、組込測定システム向けに開発されました。

ディファレンシャル干渉計は、環境変化の影響を受けることなく、長さ、傾斜角を安定して測定する製品です。

平面ミラーを使用し、組込測定システムとして、対象物の位置決めフィードバックに最適です。

トリプルビーム レーザー干渉計 SP-TR

3つの干渉計を1台に! 3本のビームで、**長さ**、**ピッチ角**、**ヨー角**を精密測定します。



内蔵する1台のレーザーを3ビームに分岐し、同一周波数のビームで長さをナノメートルの精度で同時に測定します。高精度に長さを測定するだけでなく、それぞれのビームの測長差から対応する角度を高分解能かつ高精度で測定できます。

特長

- ✓ 超高安定性の長さ/ピッチ角/ヨー角測定
- ✓ XYステージの精密位置合わせ

仕様

測定距離	: ~ 5m
長さ分解能	: 20pm
長さ不確かさ	: 0.15ppm
ピッチ角測定範囲	: $\pm 430\mu\text{rad}$ $\pm 12.5^\circ$ (リフレクター)
角度分解能	: $0.01\mu\text{rad}$
角度不確かさ	: $\pm 0.04\%$ $\pm 0.04\mu\text{rad}$

最大6軸 超高精度キャリブレータ SP15000 C5/C6

CMM、マシニングセンター、半導体検査機器などの調整、補正、キャリブレーションなど。複数軸を同時測定、測定プロセスを簡単に、そして迅速に!

長さ、**真直度 - 水平/垂直**、**ピッチ角**、**ヨー角**、**ロール角(オプション)**を一括測定します。



記載内容および画像の転載、複製、加工などは禁止です。また、記載内容は予告なく変更することがあります。ご了承ください。 Ver.1.0_2404